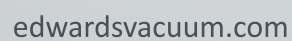




environments where innovation thrives



真空ソリューションでお客様の第一選択肢になるために

エドワーズジャパン

GREETING FROM EDWARDS JAPAN

我々エドワーズは、1919年に英国で創業し、現在では世界最大の真空ポンプおよび排ガス処理装置の総合メーカーとして、幅広い分野で事業を展開しております。

2014年にスウェーデンのアトラスコプコグループに加わり、真空技術やガス供給システム、排ガス処理装置を統合し、より多様なニーズにお応えできる体制を整えました。
この強力な技術基盤を活かし、今後の半導体製品の需要拡大、医療システムの高度化、エネルギー開発における脱炭素社会の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

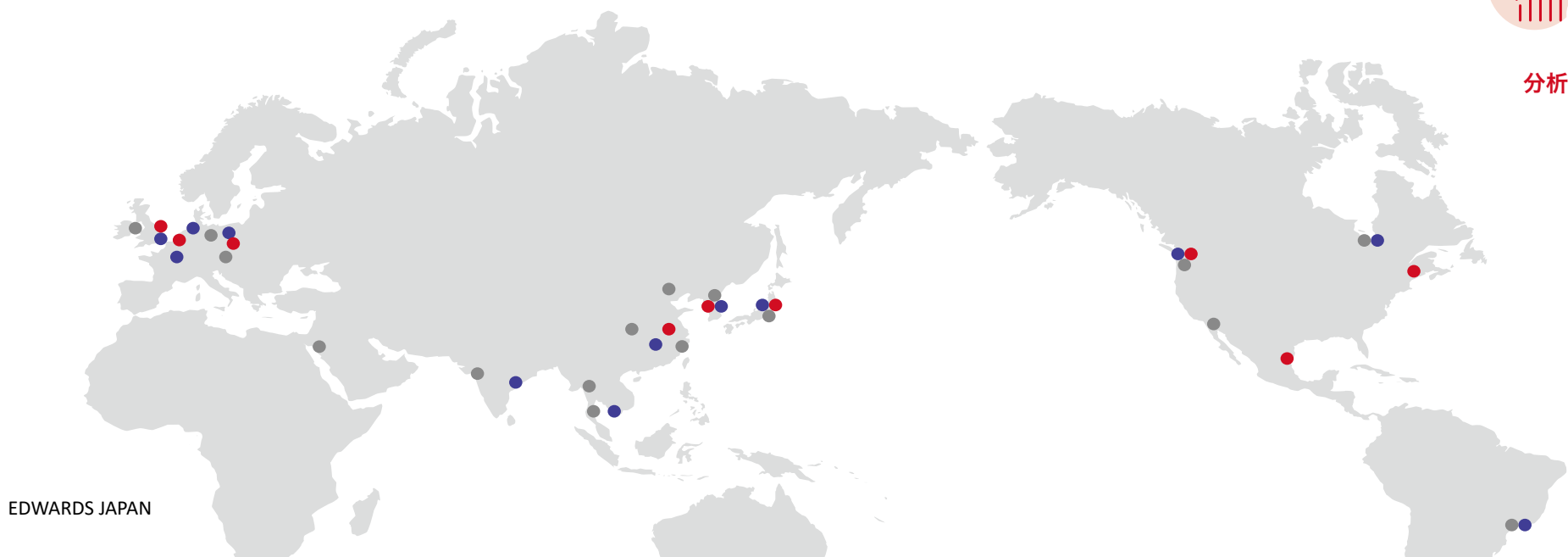
特に、磁気軸受式ターボ分子ポンプ「STPシリーズ」は、世界最高レベルの性能と品質を誇り、日本国内で開発・製造される自信作です。私たち日本法人は、この高い技術力と豊富な知見を強みに、日本国内外のお客様に誇りを持ってお届けしています。
また、世界各地のサービスネットワークに加えて、日本国内にも修理工場を備えており、お客様が安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

我々エドワーズは、持続可能な成長を目指して以下の取り組みを推進してまいります。

- ・関係するすべての人々の安全を最優先します。
- ・環境に配慮した持続可能な生産活動を実施します。
- ・脱炭素社会に向けた積極的な取り組みを発信します。
- ・世界と人々の多様性を尊重し、活力を最大限に引き出します。

お客様、従業員、そしてすべての関係者の皆様にこれらの約束を守り、より良い未来を目指して邁進してまいります。

代表取締役社長 山田 俊樹 | PC 八千代 GM Romain Lamire | STC 伊那 GM 古賀 煌翌

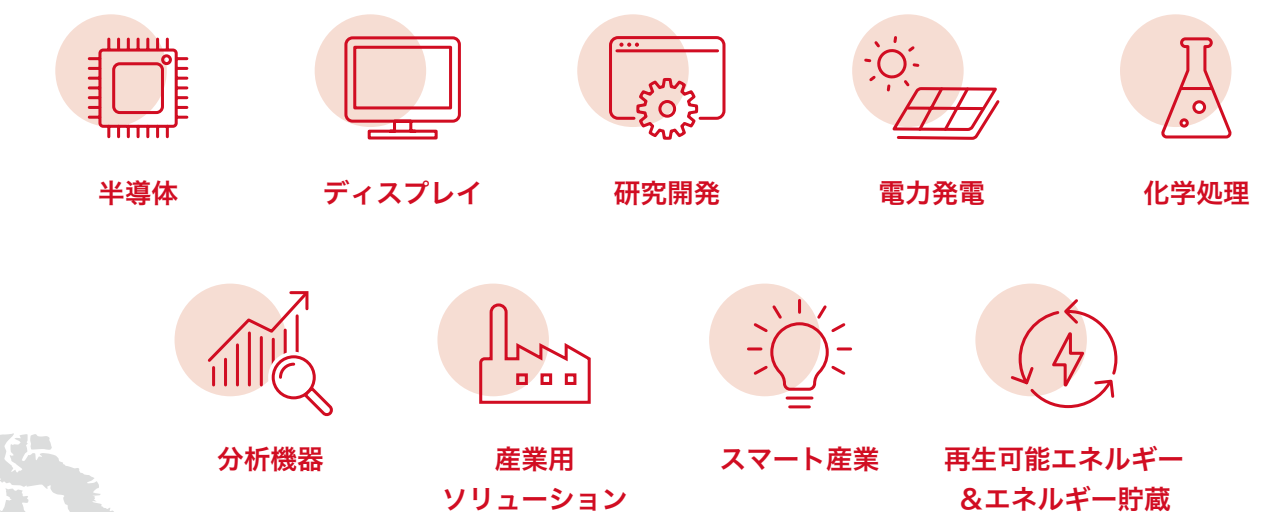


ABOUT EDWARDS

1919年に英国で創業したエドワーズは、真空ポンプと排ガス処理装置の世界最大のメーカーです。業界トップの技術力を誇る当社の製品は、半導体製造に欠かせないだけでなく、一般産業、宇宙開発など様々な分野で必要とされています。



MARKETS WE SERVE



GLOBAL PRESENCE

- CC：カスタマーセンター
- PC：プロダクトカンパニー（製造工場）
- STC：サービステクノロジーセンター（修理工場）



日本法人であるエドワーズ株式会社は 1971 年に設立され、高性能な真空ポンプ、排ガス処理装置のリーディングカンパニーとしてより高い顧客満足度を目指しています。千葉県八千代市にある本社・八千代工場をはじめ、国内に 2 つの生産工場と 1 ヶ所の修理工場、そして 10 ヶ所の営業・サービスオフィスを運営し、お客様をサポートしています。

ABOUT EDWARDS JAPAN

50+

1971 年日本法人設立
50 年を超える歴史

400+

日本の従業員数

15+

国内拠点数

7

外国籍の
社員割合 (%)

50+

R&D の
従業員数

100

再生可能エネルギー
利用率 (%)

CUSTOMER CENTRE



各地域に根ざした顧客対応

- 営業・サービス部門
 - カスタマーサポート
 - イノベーションセンター
- 国内エンドユーザー／OEM のお客様のニーズに迅速にソリューションを提供するために、装置の改善・改良およびその評価まで一括で対応

SERVICE TECHNOLOGY CENTRE



高品質で迅速な修理・メンテナンスを提供

- グローバルで共通化された設備・教育・作業手順により、作業品質の平準化を実現
- 専門知識と熟練したエンジニア
- グローバルの拠点と情報を照合し合うことで、迅速な修理・故障解析を提供
- 100% 純正部品使用

PRODUCT COMPANY



八千代工場：日本の技術を世界標準へ

- 磁気軸受式ターボ分子ポンプ (TMP) の開発と組立
- 生産能力 1,800 台／月
- 最新生産システム導入によるリードタイム短縮
- 50 年以上にわたり日本で TMP を製造
- 200,000 台以上のポンプを納入



伊那工場：TMP ブレードの内製

- TMP 部品を最先端の設備で内製
- 5 軸マシニングセンター・ロボット導入で無人運転
- より効率的な新加工方法の開発
- 伊那 STC に併設

DISTRIBUTION CENTRE



製品・部品の入出荷を担う物流拠点

- 製品・部品の入出荷と在庫管理
- 出荷前の品質チェックと適正な梱包
- 世界各地の DC と連携
- 環境負荷を低減する持続可能な物流戦略の推進

PRODUCT COMPANY YACHIYO

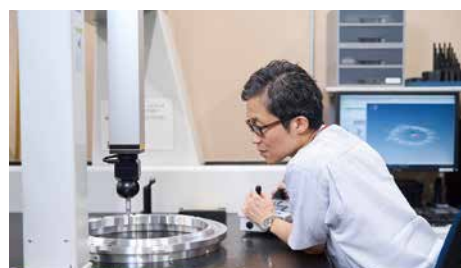


PC 八千代では、エドワーズの磁気浮上式ターボ分子ポンプ「STP」シリーズの開発・製造を行っています。1983年に世界で初めて磁気浮上式ターボ分子ポンプの量産を開始して以来、長きにわたり世界中のお客様に納入してきました。当社の技術は、日本で培った技術が基礎となり、まさに日本ならではの精密加工／制御技術が世界中のお客様のビジネスに貢献しています。



革新的な技術開発力

- 卓越した技術開発
- お客様のアプリケーションにマッチした製品の提供
- 時代の一步先を行く新機能の創造・開発



ものづくりへのこだわり

- 高品質を生み出す設計・生産・品質管理システム
- 高速な回転するローター（回転翼）の加工技術
- グループシナジーを活かした、グローバルサプライチェーンの活用



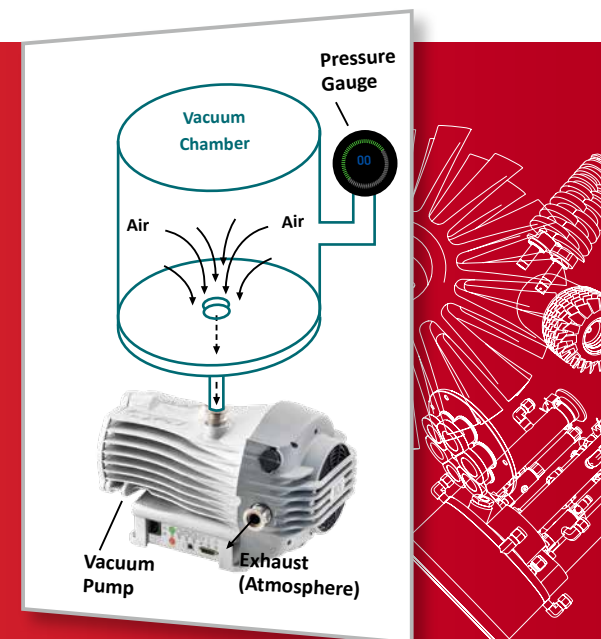
リーディングカンパニーとしてのプライド

- 磁気軸受式ターボ分子ポンプのパイオニア
- 豊富な納入実績に基づく市場からの情報／経験を製品へフィードバック
- 新しいアプリケーションへのスピーディーな対応

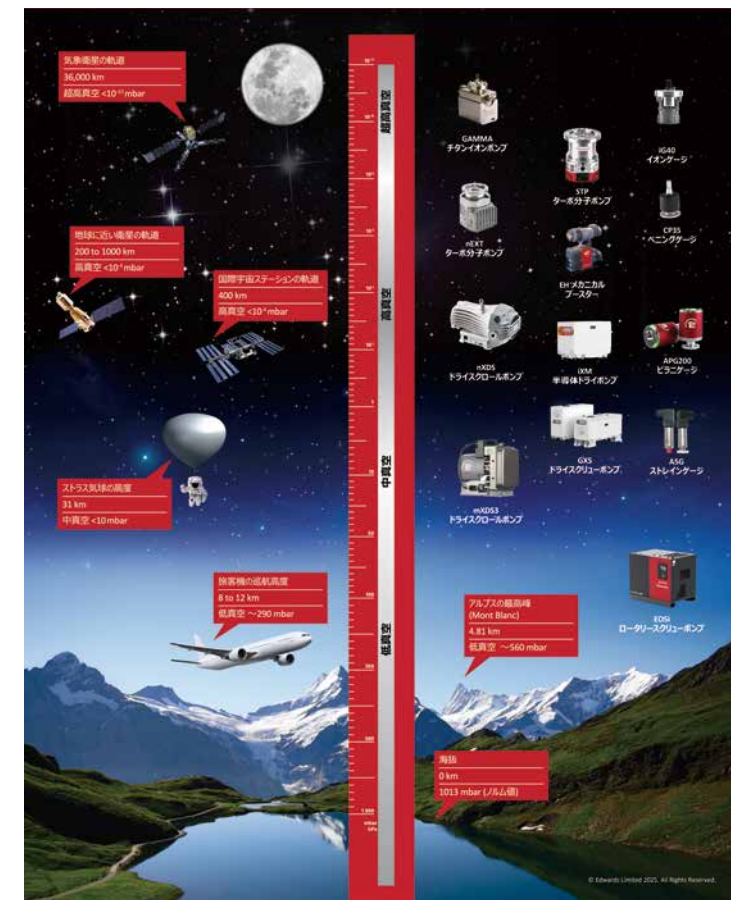
HOW TO CREATE VACUUM

密閉されたチャンバーを真空ポンプの吸気口につないで、スイッチを入れると…

- 真空ポンプがガスを排気します
- ガスが排気されるにつれて、チャンバー内の圧力が下がります
- この大気圧よりも圧力の低い状態が「真空」と呼ばれます



LOW VACUUM TO HIGH VACUUM

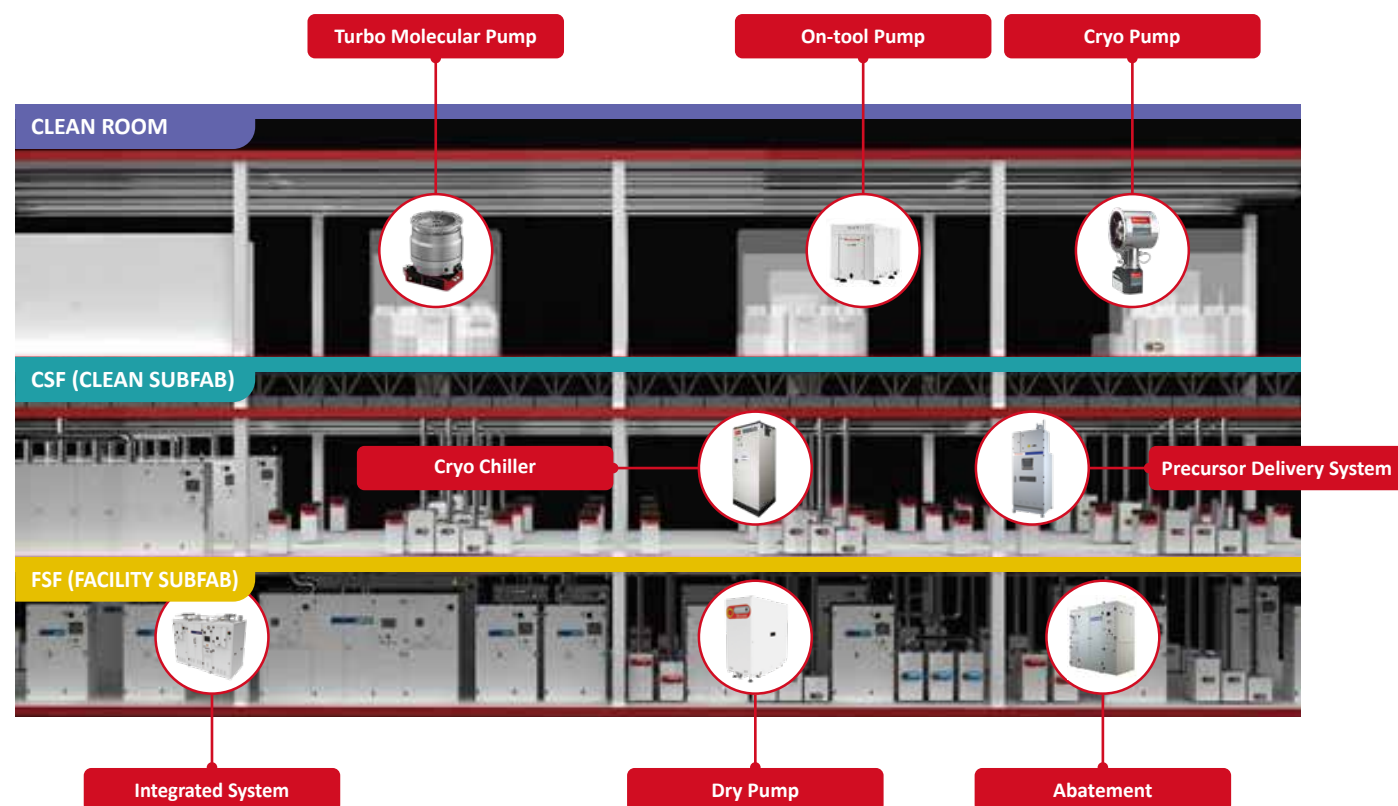


真空ポンプにも、食品の真空パックや製菓の製造プロセスで使用する「低真空領域」を作り出すポンプと、宇宙開発や半導体製造プロセスで使用する「高真空領域」を作り出すポンプなど、様々な種類があります。

また、真空の度合いを測定する真空計も同様に、低真空領域と高真空領域それぞれに適した真空計があります。

SEMICONDUCTOR BUSINESS

半導体製造では、微細な気体分子を制御し、真空状態を維持することが求められます。クリーンルーム内のプロセス装置からサブファブに至るまで、最高の真空環境を実現する多様な製品を提供しています。プロセスガスを処理する排ガス処理装置を含めたトータルソリューションシステムで、お客様のニーズに応えます。



iXL、iXM、iXH 半導体ドライポンプ

iXH、iXM、iXL シリーズは半導体、FPD、Solar、LED などの産業全般に使用されるドライ真空ポンプです。エドワーズの 4/5 世代ポンプ技術が総集結しています。

- ・ 小型化、軽量化の実現、最小の設置スペース
- ・ 高いスループットと最適化されたタクトタイムの提供
- ・ 維持管理費用の最小化を実現
- ・ 優れたパウダー・水素 (H₂) 処理能力
- ・ 低騒音、低消費電力、低振動ポンプ
- ・ 便利な FabWorks ネットワークベースの管理が可能



ターボ分子ポンプ (STP 磁気浮上式ターボ分子ポンプ)

磁気ベアリングによりロータが完全に浮上しているため、長時間の安定稼働、クリーンな排気、ミニマムメンテナンス、低振動が求められる用途に最適です。完全オイルフリーであるため、汚染の心配もありません。

- ・ 排気速度 300 ~ 4,500 l/s
- ・ 低消費電力、省スペース、完全オイルフリー
- ・ コントローラー体型、超高真空シリーズなど豊富なバリエーション
- ・ 大流量や反応性生成物対策に優れ、高圧縮比にも対応可能



排ガス処理装置 (ATLAS / PROTEUS)

半導体製造工程で排出される、有毒ガスや地球温暖化ガスを安全に処理する環境ソリューションです。ATLAS は燃焼技術を活用し、広範囲なアプリケーションをカバー。PROTEUS はプラズマ技術を活用し、炭素排出量を削減しながら高効率なガス処理を実現します。

- ・ PFC ガスを含む温室効果ガスの効果的な分解と管理
- ・ Dual バックアップ構造による高い信頼性 (PROTEUS)



統合システム (E ZENITH / AXENTIS)

ドライ真空ポンプと排ガス処理装置を一体化し、環境安全性と管理の利便性を向上しました。E ZENITH は、EUV 露光装置に最適化されており、全過程で排出される大量の水素及び有害物質の一括処理が可能です。AXENTIS は、E ZENITH の後継の統合システムで、コンポーネントの規格化、ユーティリティ消費量の最適化を実現します。

- ・ SEMI S2 安全保証システム
- ・ モジュール構造の採用



プリカーサーデリバリーシステム (ACM / Ceres)

プリカーサーデリバリーシステムの ACM と Ceres 製品は、半導体産業を中心に、太陽光パネル、ディスプレイ、一般産業など幅広いお客様に導入されています。高い技術力を持ち、特定のニーズを満たすカスタマイズ製品の設計・製造にも対応。大容量のガスでも、バルクソースからプロセスチャンバーまで安定して供給します。

- ・ 均一で安定したガス流量制御により、プロセスの品質向上をサポート
- ・ 腐食性・反応性ガスを含む多様なプロセスガスに対応
- ・ 標準製品だけでなく、各プロセスの要件に合わせたオーダーメイド製品も提供



クライオポンプ・クライオチラー (CTI / Polycold)

CTI / Polycold 製品は、高性能でエネルギー効率の高い極低温ソリューションを提供します。用途は超高真空発生、真空コーティング、極低温冷却、宇宙シミュレーション、R&D の温度調整など多岐にわたります。

- CTI: 極低温高真空技術を用いたクライオポンプ
- ・ 水蒸気や窒素、アルゴンから水素などのガスを高効率で捕捉
- ・ 低振動・低ノイズのため、超高真空かつ高精度が求められるプロセスに最適

Polycold: 最大 4,000 ワットの冷却が可能な閉ループ極低温冷凍システム

- ・ 温度範囲 -203 ~ -98°C のクライオチラーとクライオクーラー
- ・ チャンバー内の水蒸気を迅速に凝縮・除去し、真空到達時間を短縮。また、TMP と組み合わせて使うことで、さらなる高真空化が可能



INDUSTRIAL VACUUM

コーティング、包装、凍結乾燥、化学、リチウムイオン電池など、様々な産業分野においてお客様の製品品質とコスト効率を高めるために最適なソリューションを提供します。

GXS ドライスクリュープンプ

- ・到達真空度：1 Pa
- ・排気速度：160 ～ 3,450 m³/h
- ・低騒音、環境にやさしい、省エネ
- ・リモートコントロールモジュール及び
オンボードコントロールパネル搭載
- ・コンパクトなデザイン (ブースター内蔵)
- ・用途：一般産業 – 二次電池、ラミネート、プラズマ等



EDS ドライスクリュープンプ

- ・到達真空度：5 Pa
- ・排気速度：200 ～ 460 m³/h
- ・優れた汚染物質処理能力と長寿命
- ・水冷式および空冷式システム
- ・ケミカル仕様あり
- ・用途：一般産業 – 二次電池、製薬、熱処理等



nES ロータリーベーンポンプ

- ・到達真空度：8 Pa
- ・排気速度：200 ～ 840 m³/h
- ・水冷式および空冷式システム
- ・内蔵型オイルミストフィルター
- ・用途：一般産業 – コーティング、食品乾燥、製薬等



EH メカニカルブースター

- ・排気速度：310 ～ 5,000 m³/h
- ・流体カップリング採用によりポンプの
ダウンタイム削減
- ・大気圧からの運転可能
- ・当社様々なポンプ (EXS, EDS, E2M など) と組み合わせ可能



E2M ロータリーベーンポンプ

- ・到達真空度：0.1 Pa
- ・排気速度：40 ～ 300 m³/h
- ・様々なアクセサリが装着可能
- ・堅牢でパワフルな性能
- ・用途：一般産業 – 光学コーティング、凍結乾燥等



EXS ドライスクリュープンプ

- ・到達真空度：1 Pa
- ・排気速度：450 ～ 5,760 m³/h
- ・堅牢、高速排気、簡単操作
- ・インバータ搭載
- ・コンパクトなデザイン (ブースター内蔵)
- ・用途：一般産業 – 二次電池、コーティング、射出成形等



EOSi オイルシール型スクリュープンプ

- ・到達真空度：50 Pa
- ・排気速度：400 ～ 5,000 m³/h
- ・インバータ搭載
- ・使いやすいEJGO インターフェース
- ・エネルギー消費量を最大 50%削減
(省エネ診断ツール有)
- ・用途：ピックアンドプレース、集中排気等



E2S ロータリーベーンポンプ

- ・到達真空度：0.3 Pa
- ・排気速度：45 ～ 87 m³/h
- ・3つのガスバラストオプション
- ・ブースター接続オプション品有
- ・用途：一般産業 – 真空脱気、真空乾燥、熱処理等



LRP 水封式ポンプ

- ・到達真空度：3,300 Pa (33 mbar)
- ・排気速度：24 ～ 40,000 m³/h
- ・プロセスガスに応じた材質選択が可能
(Cl,Stainless steel or Duplex)
- ・カスタマイズシステムパッケージを提供
- ・用途：一般産業 – 石油化学、発電プラント、製薬等



SCIENTIFIC VACUUM

高性能な真空ポンプや計測機器、真空システムの開発・製造を通じて、科学研究を支え、科学の発展に貢献しています。分析機器、研究開発、高エネルギー物理学など、さまざまな市場に提供しています。

nEXT ベアリング式ターボ分子ポンプ

- ・到達真空度：< 5x10⁻⁸ Pa
- ・排気速度：55 ～ 1,250 L/s
- ・水冷式および空冷式システム
- ・用途：コーティング、加速器、
質量分析計、真空オープン、化学薬品



mXDS3 ドライスクロールポンプ

- ・到達真空度：10 Pa
- ・排気速度：58 L/min
- ・空冷式システム
- ・低消費電力
- ・用途：コーティング、加速器、質量分析計、真空オープン



nXRi ドライポンプ

- ・到達真空度：3 Pa
- ・排気速度：500 ～ 2,000 L/min
- ・空冷式システム
- ・低騒音・低消費電力
- ・用途：加速器、質量分析計、
リーク検出器、真空オープン、プラズマ



GAMMA イオンポンプ

- ・到達真空度：< 1x10⁻⁹ Pa
- ・排気速度：0.2 ～ 1,200 L/s
- ・無騒音・無振動
- ・ガス捕捉式ポンプ
- ・用途：加速器、質量分析計、UHV



真空ゲージ&コントローラ

- ・< 10⁻⁷ ～ 大気圧まで測定可能なゲージとコントローラ
- ・小型でスタイリッシュなデザイン
- ・用途：加速器、コーティング、半導体、質量分析計、リーク検出器



ターボ分子ポンプステーション

- ・到達真空度：< 5x10⁻⁸ Pa
- ・排気速度：55 ～ 400 L/s
- ・空冷式システム
- ・ワンボタンポンプ運用
- ・用途：化学、加速器、質量分析計



nXDS ドライスクロールポンプ

- ・到達真空度：0.7 Pa
- ・排気速度：103 ～ 366 m³/min
- ・低騒音・低消費電力
- ・用途：加速器、質量分析計、リーク検出器、
真空オープン



RV / EM ロータリーベーンポンプ

- ・到達真空度：0.1 Pa
- ・排気速度：15 ～ 550 L/min
- ・空冷式システム
- ・低騒音
- ・用途：質量分析計、電子顕微鏡、
凍結乾燥、コーティング、真空オープン



ELD500 リークディテクタ

- ・最小リーク検出量：< 5x10⁻¹⁰ Pa(油式), < 3x10⁻⁹ Pa(ドライ式)
- ・排気速度：3 m³/h (油式), 1.8 m³/h(ドライ式)
- ・空冷式システム
- ・軽量で移動しやすい
- ・用途：加速器、コーティング、
半導体、機械工学、自動車



SERVICE

Global expertise, locally applied

エドワーズには、「**全製品に対して、世界中どの地域であっても同様のサービスを提供する**」というサービス方針があります。

緊急のサポートが必要な場合でも、長期的なトータルサービスパートナーが必要な場合でも、お客様の機器の性能とアップタイムを最大化することを優先します。



半導体向けサービスソリューション（SEMI サービス）

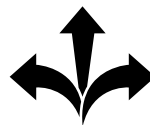
真空と除害のグローバルリーダーとして、世界中のお客様が設備のダウンタイムとウェハの無駄を回避し、ファブの生産性を最大化できるようサポートします。最新のデジタルツールも駆使し、予知保全など先進的なソリューションを提供しています。



EdCentra



サービスアップグレード



Flexible なサービス
ソリューションの提案



一般産業向けサービスソリューション（VT サービス）

お客様のニーズに合わせたマネージドメンテナンスから重要部品・オイルの迅速な供給まで、柔軟に対応することが可能であるため、エドワーズの真空システムは日々お客様のご要望に応え続けることができます。



純正部品・
オイル・グリース



オンサイト
サービス



ゲージの
較正



遠隔保守
Genius

INNOVATION CENTRE



技術革新のスピードが速くなるにつれ年々厳しくなるお客様の要求に応えるべく、エドワーズはイノベーションセンターを設立しました。

八千代ラボでは、半導体プロセスに使用されるシランなどのガス供給システムに加え、それらを実験するための真空ポンプ、排ガス処理装置、ガス分析装置を完備しています。

英国本社のグローバルテクノロジーセンターをはじめ、日本、アメリカ、中国の各拠点と連携して新たな技術・製品開発を進めています。



既存の製品を改良・改善

国内のエンドユーザー・OEM のお客様で発生している問題に対してラボで実験を行い、既存の製品を改良・改善して、最適なソリューションを提供していきます。



新技術・製品開発

お客様とともに新たな製品のプロトタイプを検討するほか、関連部署と連携することで製品開発のサポートを行っていきます。

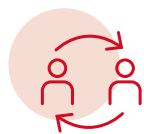


総合排気ソリューションの提供

真空ポンプなどの個別製品にとどまらず、排気システム全体を見据えた総合的なソリューションを提供します。さらに、SDGs を踏まえ、環境負荷の低減に向けた技術・製品の開発を進めています。



| EDWARDS VALUES



INTERACTION

お客様とのコミュニケーション、
チームワークを大切にします



INNOVATION

革新的な製品開発を行い、
高い価値を提供し続けます



COMMITMENT

約束を守り、
常に高い期待を超える
ように努めます

| WORKING CULTURE

01 Safety & Sustainability

私たちは、安全と健康的な職場環境
のために、安全・衛生・環境・品質
(SHEQ) を第一に考えます。



100 万時間無災害達成



社用車の EV 化

02 Diversity & Inclusion

私たちは、ダイバーシティ&インクルー
ジョンを重視し、すべての人に公平な
機会を提供し、個人の発展を支援します。



Woman's Network の発足



男性の育児休暇促進

03 Highest Ethical Standard

私たちは、企業倫理と社会的、環境
的な業務遂行に関連する方針を盛り
込んだ経営規範に従います。



●アトラスコプコグループの企業
文化や価値観をまとめた「The
Book」を活用したサークルト
レーニング

●行動規範 (Code of Conduct)
の定期的な研修

| DEVELOPING WITH EDWARDS

イノベーションという言葉は、エドワーズの製品やサービスだけでなく、社員一人ひとりにも
深く根付いています。エドワーズでは、継続的な学びを通じたスキル向上と自己成長を積極的に
支援する文化を大切にしています。会社のサポートを受けながら、自らの手でキャリアを築いて
いくことが可能です。



年間 40 時間の推奨学習時間

全従業員に年間 40 時間以上の学習が推奨されており、専門スキルやソフトスキルの
向上を支援する多様な研修や e ラーニングを提供しています。



豊富な無料学習ツール

アトラスコプコグループ全体の学習管理システムには、具体的なテーマや機能、役割に
合わせて制作された学習コンテンツが充実しています。その他、外部教育も受講可能です。



資格試験受験料の支援

業務として必要な資格試験の受験料は、会社が 100% 負担しています。これにより、
学びの意欲を促進し、従業員のさらなる成長を後押ししています。

| INTERNAL MOBILITY

社員が自分のキャリア目標を実現させるため、グローバルのアトラスコプコグループのオープン
ポジションに挑戦できる仕組みが整えられています。異なる国や地域で新たな経験を積み、多彩
なプロジェクトを通じてさらなる可能性を追求できます。

Employee Development & Engagement

新しいスキル及び知識を習得する機会を提供し、人脈の拡充を図る

Career Development

キャリア開発を促進し、新たな職務への意欲を高められます

Talent Retention

職務適性の違いによる離職率の低減と組織文化の強化

Succession Planning

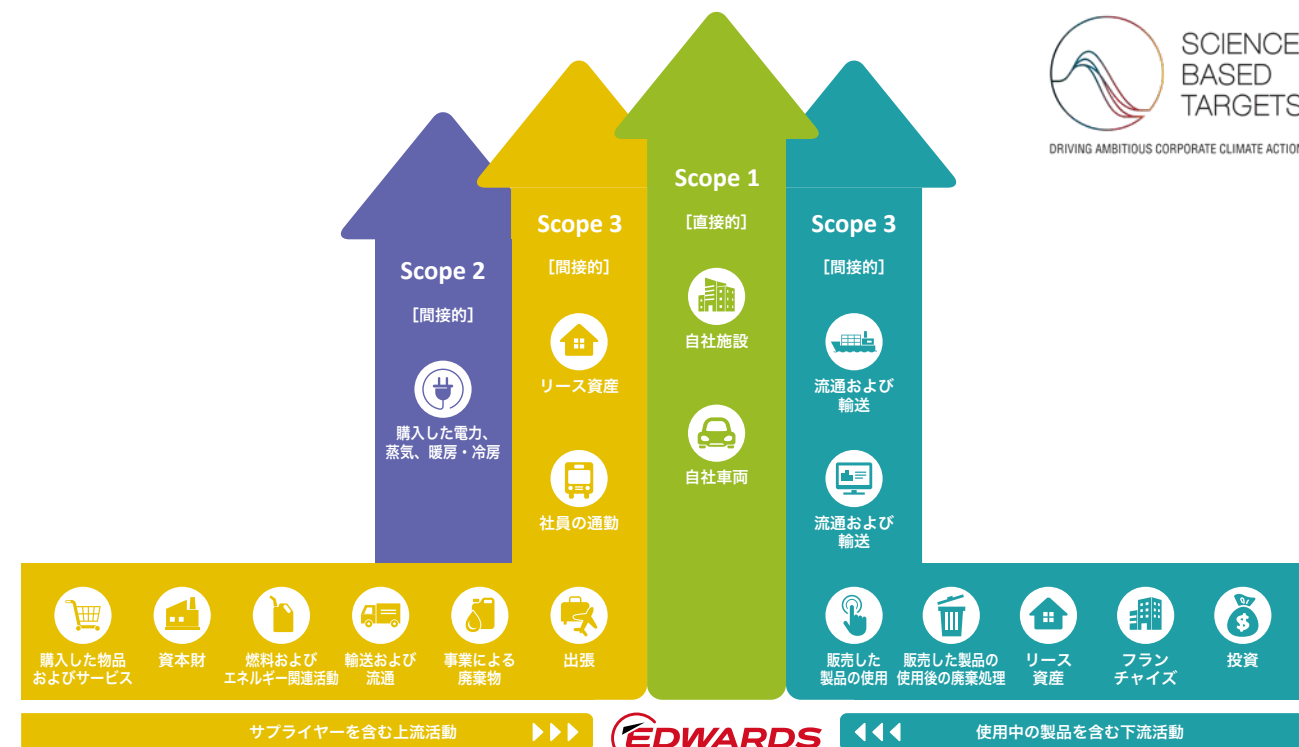
次世代リーダーの発掘及び育成の機会を提供

| SUSTAINABILITY THROUGH COLLABORATION

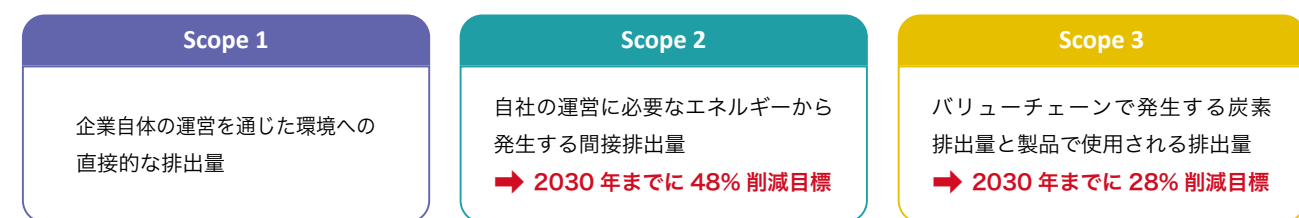
持続可能な経営と環境にやさしい戦略を通じて、気候変動への対応に取り組んでいます。

科学に基づく温室効果ガス排出削減目標 (Science Based Targets) の設定

エドワーズは、パリ協定で示された世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標に従い、科学的根拠に基づく排出削減目標を設定しました。



エドワーズの炭素排出量削減目標



半導体気候関連コンソーシアム (SCC) に加入



エドワーズは、気候変動問題に対する認識を高め、半導体バリューチェーンの気候影響の最小化と脱炭素化のために国際半導体装置材料協会 (SEMI) で発足した気候関連コンソーシアムの創立メンバーとして、半導体産業の様々な会員企業と共に会員企業の ESG 活動を支援し、NGO、地域およびグローバルコミュニティと協力して環境問題を解決するために努力していきます。

| ENVIRONMENT, SOCIAL & LOCAL VALUES

エドワーズは、事業展開する各地域社会とのつながりを大切にし、さまざまな形で積極的に関わっています。日本においても、社会貢献や環境保全を目的とした活動に力を入れており、以下のような取り組みを通じて地域社会の発展と持続可能な未来づくりに貢献しています。



Water for All

Water for All (すべての人にきれいな水を) は、アトラスコプコグループの地域貢献活動です。従業員からの寄付・ボランティア活動を通じて、清潔な飲料水、衛生設備を提供しており、1984年の開始以来、世界中の何百万人もの人々を支援してきました。

バラボランティア

本社・八千代工場の最寄り駅である東葉高速鉄道の八千代緑が丘駅の駅前ロータリーおよび京成バラ園に続くプロムナードの花壇において、地域のボランティア団体と協力して市花であるバラの育成と保全に取り組んでいます。



せとうち半導体コンソーシアム

半導体に関連する最先端の研究開発と人材の育成支援するため、「せとうち半導体コンソーシアム」に協賛しています。社員を講師として派遣し、専門知識や実務経験を活かした講義を通じて、次世代の技術者の育成に取り組んでいます。

Part of Atlas Copco Group



スウェーデンのストックホルムに本社を置くアトラスコプコグループは 53,000 名の社員を擁し、世界 180 カ国以上の市場でビジネスを展開しています。

創業から 150 年以上、日本のお客様とも 100 年以上の関わりを持つアトラスコプコグループは、時代とともに製品と組織を革新しながら世界中で事業を展開してきました。

アトラスコプコグループの概要



180 カ国以上にわたるお客様



71 カ国に **53,000** 人の従業員



1873 年に
スウェーデン・ストックホルムで創業



売上高 **1,767** 億 SEK
(スウェーデンクローネ)

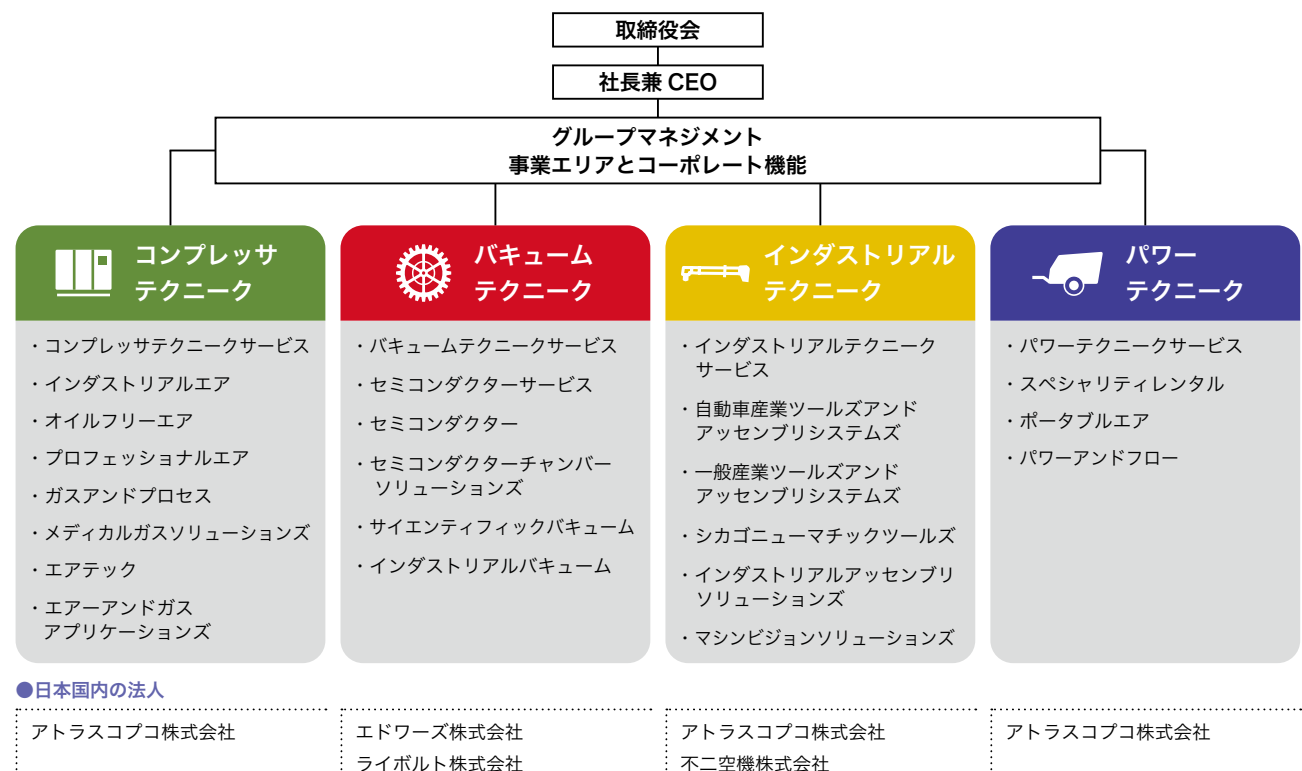
2 兆 **5,320** 億円
(2024 年の平均為替レートに基づく)



営業利益率 **21.5%**

分権型の産業機械グループ

現在は 4 つのビジネスエリアの下に 24 のディビジョンが属する分権型グループとなっています。ビジネスエリアの主な目的は、その事業範囲内で最先端の技術を開発し、グループの目標と戦略をフォローアップすることにあります。これには、人や環境、社会への取り組みも含まれます。各ディビジョンはそれぞれの利益責任を負う最高位の事業体で、製品開発、製造、マーケティング&セールスを担当します。

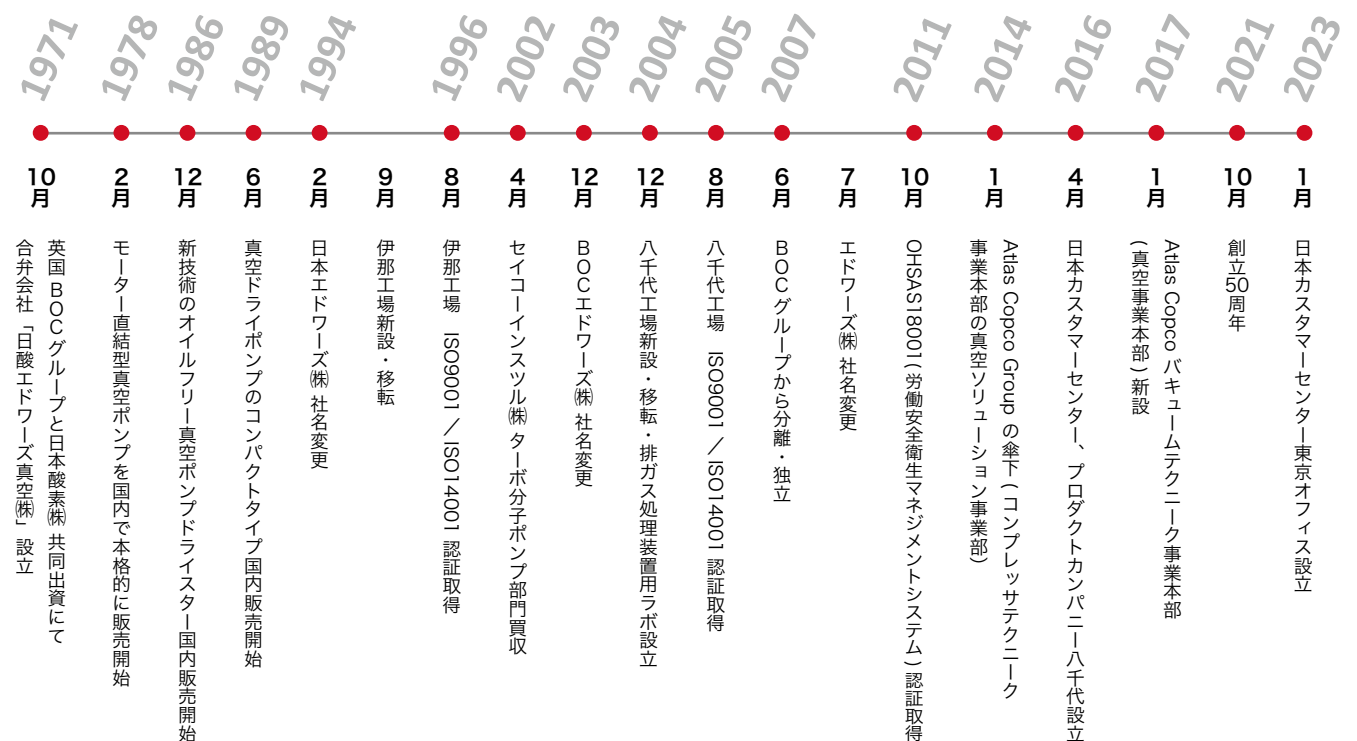


OVERVIEW AND HISTORY

会社概要

会 社 名	エドワーズ株式会社 (Edwards Japan Limited)
設 立	1971 年 10 月
資 本 金	4 億 8,000 万円
代 表 者	代表取締役社長 山田 俊樹
事 業 所	■本社・八千代工場：千葉県八千代市吉橋 1078-1 ■本社・東京オフィス：東京都中央区日本橋小舟町 12-6 CIRCLES 日本橋小舟町 5F ■伊那サービステクノロジーセンター：長野県伊那市大字西箕輪字東原 2640-10 その他営業所・サービスオフィス
事業内容	各種真空ポンプ、真空計、排ガス処理装置の製造・開発設計・販売・サービス
取引銀行	・三菱 UFJ 銀行 田町支店 ・三井住友銀行 東京営業部 ・シティバンク、エヌ・エイ 東京支店

沿革 (日本のみ)



EDWARDS JAPAN CONTACTS

本社・八千代工場

〒276-8523 千葉県八千代市吉橋1078-1

カスタマーセンター(営業・サービス部門)TEL: (047)458-8836/プロダクトカンパニー(工場関連部門)TEL: (047)458-5011

本社・東京オフィス

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-6 CIRCLES日本橋小舟町 5F | TEL: (03)6803-5753

伊那サービステクノロジーセンター・伊那工場

〒396-0041 長野県伊那市大字西箕輪字東原2640-10 | TEL: (0265)74-5500

三重営業所・サービスオフィス

〒510-8014 三重県四日市市富田4-2-2 魚平ビル 2F | TEL: (059)361-7066

大阪営業所・サービスオフィス

〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2-11-16-B | TEL: (06)6491-7350

広島営業所・サービスオフィス

〒739-0025 広島県東広島市西条中央1-16-2 ドーメンビル 101 | TEL: (082)493-7799

北上サービスオフィス

〒024-8555 岩手県北上市北工業団地5-29 キオクシア岩手(株) 構内仮設事務所 D棟1F | TEL: (0197)62-8680

仙台サービスオフィス

〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-2-3 | TEL: (022)373-8525

庄内サービスオフィス

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添字一里塚132 | TEL: (0235)78-7270

つくばサービスオフィス

〒305-0033 茨城県つくば市東新井20-5 グローバル5 101号 | TEL: (029)879-5561

山梨サービスオフィス

〒407-0014 山梨県韮崎市富士見1-7-3 | TEL: (0551)35-9250

横浜サービスオフィス

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8 日総第16ビル 11階 | TEL: (045)620-6901

九州サービスオフィス

〒860-0803 熊本県合志市福原1-29 (株)旭精機内 | TEL: (096)233-9102

流山ディストリビューションセンター

〒270-0105 千葉県流山市森のロジスティクスパークニ丁目806番地1 GLP ALFALINK流山8 2階D区画

TEL: (04)7189-7952

© Edwards Limited 2025. All rights reserved. EdwardsとEdwardsのロゴはEdwards Limitedの商標です。

Edwards Ltd, registered in England and Wales
No. 6124750, registered office: Innovation Drive, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9TW, UK.

Part of the Atlas Copco Group

